

2019年度 ナノテクキャリアアップアライアンス
産総研 SCR 超微細加工プロセスコース

■目的、対象者：

世界最高クラスのナノデバイス製造装置(300mm ウェハ対応)、最先端評価装置からなる産総研スーパークリーンルーム (SCR) が持つ機能を最大限に活用し、世界に通用するプロセスインテグレータの育成を目指す。育成対象者は、SCR にて研究開発業務に従事している第一線の研究者及び高度専門技術者等から直接指導を受け、プロセスインテグレータに必要とされる技術と素養を習得する。

■募集人数： 15 名程度 (団体の場合はご相談ください)

■期間： 短期型 3 日間 コース
2019 年 7～8 月

■会場： 産業技術総合研究所 つくば西 TIA 連携棟

■内容：

- 第 1 日 ガイダンスおよび概要と見学
デバイスおよびプロセス概要、SCR 全体見学
- 第 2 日 デバイスとプロセス
先端デバイス概要
個別プロセス講義と実習
- 第 3 日 デバイス評価
計測、特性評価等
報告書作成、修了式

■受講料： 100,000 円

■連絡先： 産業技術総合研究所 TIA 推進センター CUPAL 事務局
(nanotech-cupal-ml(atmark)aist.go.jp)